

论文

光学薄膜折射率和厚度测试仪检定规程解读

杨照金;王雷;黎高平;许荣国

西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065

摘要:

简要介绍光学薄膜折射率和厚度测试仪检定规程的构成, 被检测量仪器的技术指标、主要检定参数和检定方法等。该规程适用于光谱椭偏法测量光学薄膜折射率和厚度的仪器, 在从事光学薄膜研究、生产和使用的单位具有广泛的应用前景。

关键词: 检定规程 光学薄膜 厚度测量 折射率测量

Explanation of verification procedure for tester of optical film refractive index and thickness

YANG Zhao-jin;WANG Lei;LI Gao-ping;XU Rong-guo

Xi'an Institute of Applied Optics, Xi'an 710065, China

Abstract:

The content of the verification procedure for testers of optical film refractive index and thickness is described. The specifications of the instrument under test, the main verification parameters and the verification method are introduced. The procedure applies to the instruments measuring the optical film refractive index and thickness by means of spectrum ellipsometry method. It has a great potential in development, production and application of optical film.

Keywords: verification regularation optical film measurement of thickness measurement of refractive index

收稿日期 1900-01-01 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者: 杨照金

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

文章评论 (请注意:本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- PDF(144KB)
- [HTML全文]
- 参考文献

服务与反馈

- 把本文推荐给朋友
- 加入我的书架
- 加入引用管理器
- 引用本文
- Email Alert
- 文章反馈
- 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- 检定规程
- 光学薄膜
- 厚度测量
- 折射率测量

本文作者相关文章

- 王雷
- 黎高平
- 许荣国

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 0572